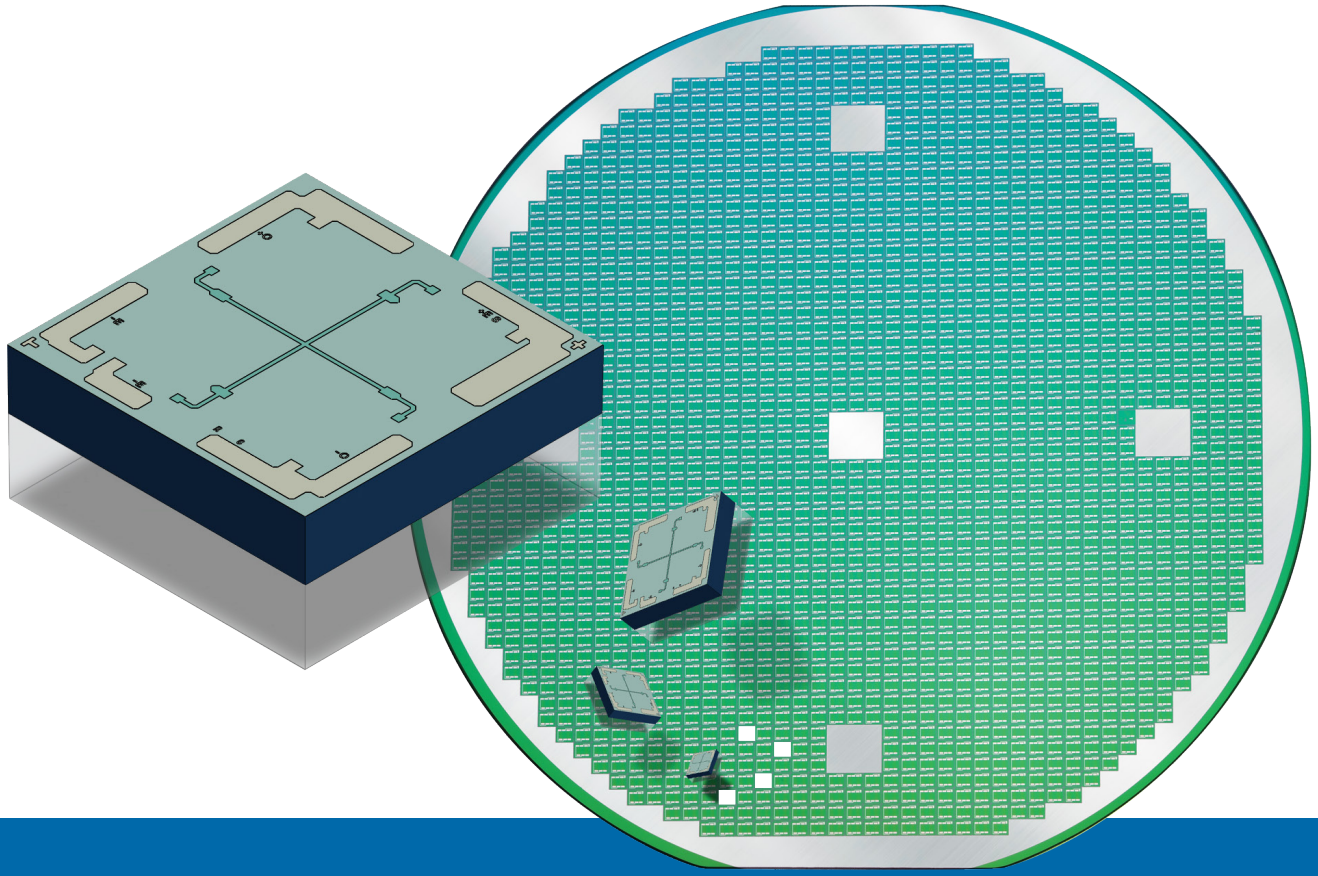
Die neue J+ Series piezoresistive MEMS

Die neue piezoresistive MEMS-Drucksensorserie J+ ermöglicht die präzise Messung niedriger und sehr niedriger Drücke und eignet sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen in hohen Stückzahlen.



LIEFERKETTE: Patentierte Technologie, eigenständige Entwicklung und Fertigung

TECHNOLOGIE: Druckempfindliche Membran hergestellt mittels KOH-Ätzen auf epitaktischem 6 Zoll-Siliziumwafer; piezoresistive Wheatstone-Messbrücke und anodisch gebondetes Glassubstrat

ANWENDUNGEN: Ölgefüllte Druckaufnehmer und Drucktransmitter. Unkompensierte sowie vollständig kompensierte und verstärkte Drucksensoren

MEDIENKOMPATIBILITÄT: saubere, trockene Luft und nicht korrosive Gase und Flüssigkeiten

HIGHLIGHTS:

Abmessungen	2.0 x 2.0 x 0.9 mm
Empfindlichkeit	bis zu 4350 µV/V/kPa
Stabilität	<0.1%FS

EIGENSCHAFTEN:

Layout	halboffene und geschlossene Brückenkonfiguration
Glasdicke	0.5 mm
Druckbereich	0.3 bis 15 psi (2 to 100 KPa)
Temperaturbereich	-40…+150°C
Druckbereich	Absolut- und Differenzdruck

AMSYS GmbH & Co. KG • An der Fahrt 4, 55124 Mainz, Deutschland • Tel: +49 6131 469875-0
info@amsys.de • www.amsys.de